PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-303063

(43)Date of publication of application: 09.12.1988

(51)Int.CI.

C23C 14/34

(21)Application number : **62–133295**

(71)Applicant: DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

30.05.1987

(72)Inventor: YAMASHITA MASAMI

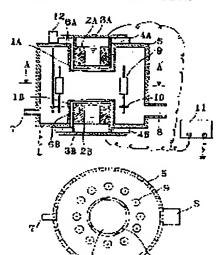
SAWA HIROAKI TANAKA TOMOSHI

(54) PRODUCTION OF MAGNETIC RECORDING CYLINDRICAL MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To form uniform magnetic metallic films on the surfaces of cylindrical base bodies with good productivity by disposing two sheets of targets to face each other and disposing the base bodies around the targets in parallel with the central axes of the two targets.

CONSTITUTION: Magnets 2 for impressing plasma focusing magnetic fields are fixed on the rear sides of, for example, the targets 1A, 1B facing each other. The above-mentioned targets and magnets are supported by stainless steel holders 3 and are airtightly fixed via insulators 4 to a bell-jar 5. The side faces of the holders are covered by shielding plates 6. 12 Pieces of the Al cylinders 9 are disposed around the targets 1A, 1B in respectively parallel with the central



axes of the targets and are made rotatable by means of gears 10. The inside of the jar 5 is evacuated to a vacuum through a discharge port 8. Gaseous Ar is introduced into the jar through an introducing port 7 and sputtering is executed by impressing a negative DC voltage to the holders 3 so that magnetic layers consisting of a Co-Pt alloy, etc., are formed on the surfaces of the cylinders 9.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許厅(JP)

⑪特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-303063

(a) C 14/2

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 昭和63年(1988)12月9日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 顧 昭62-133295

❷出 願 昭62(1987)5月30日

⑫発 明 者 山 下 正 己 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社 電子材料研究所内

電子材料研究所内 電発明者 田中 智志 東京都町田市旭町3

東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社 電子材料研究所内

⑪出 顋 人 電気化学工業株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

明 細 書

1.発明の名称

磁気記録円筒状媒体の製造方法

2.特許請求の範囲

同一の磁性材料からなる 2 枚のターゲットを互いた向い合わせて配置し、非磁性硬質材料からなる円筒を前記ターゲットの周囲に、両ターゲットの中心軸と平行に配置し、前記円筒をその軸を中心に回転させながらスパッタすることを特徴とする磁気配銀円筒状媒体の製造方法。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は円筒形の磁気配録媒体の製造方法に係り、特にターゲットの利用効率、磁性膜の磁気特性に優れたスペッタ法による磁気記録円筒状媒体の製造方法に関する。磁気配録円筒状媒体いわゆる磁気ドラムは電算機の記憶装置に用いられているが、近年は電子カメラ用の配録媒体としても期待されている(文献:特別昭58-73072号公報)。

(従来の技術)

磁気配銀円筒状媒体は非磁性硬質材料からなる 円筒の表面に磁性体を設け、磁気ヘッドにより情 報を普込み、あるいは読み出しをするものである。

従来の磁気配録円筒状媒体は金属円筒の表面に 針状 r-Pe aOs などの強磁性像 数末を合成樹脂中に 分散させて歯布したりあるいは磁性合金メッキの 被膜を設けることによつて製造されている(文献 :「総合電子部品ハンドナック」1002-1006 頁(社)日本電子機械工業会鍋、電波新聞社昭和 55年発行)。

近年、磁気配録媒体の高配録密度化サンび小形化の製設が強く、これにともない金属磁性薄膜を 磁性層とした円荷形の磁気配録媒体がとくに注目 されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、磁性合金メッキによる磁性膜の 形成はメッキに時間がかかるため生産性が悪いと いう欠点がある。いつほう、磁気ディスクあるい は磁気テープの製造にないてはスパッタ法による 磁性膜の形成が実用化され始めた。しかし、基体が円筒の場合はその容積が大きく、また、その袋面が曲面であるために、磁性体の均一な被優がむずかしく、また、メーゲットから飛散する磁性材料の利用率が悪く、効率よく生産することは困難である。

この発明は円間形益体の表面に均一に金属磁性 腹が形成され、磁性材料の利用率が高く、かつ生 磁性が高い磁気配象円筒状媒体の製造方法を提供 することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

個隔が狭すぎると内間の表面に磁性薄膜を均一に形成させることがいずかしい。両ターアット間に発生するプラズマを破れてスパックの効果でであることががあることが好きい。スパックの効果を高めるためにターアットはのの場合ではない。ターアットの個数は可能を限りない。また同時によるとの利用率が高くなり、でも好ましい。

基体の軸と両ターケットの中心軸とは平行でなければならない。平行でないと、基体の軸方向で 磁性体のスパッタ密度にむらを生ずる。また、当 然のことながら、スパッタ中は基体をその軸を中 心にして回転させないと基体の円周方向で磁性体 のスパッタ密度にむらを生ずる。

スパッタ時の雰囲気は 1 0⁻² ~ 1 0⁻³ torr の アルゴンが好ましく、このような雰囲気ではかっ 一放電が起り、スパッタが高速で行なわれる。 (実施例) せて配置し、非磁性硬質材料からなる円筒を前記 ターゲットの問題に、両ターゲットの中心軸と平 行に配置し、前記円筒をその軸を中心に回転させ ながらスパッタすることを特徴とする磁気記録円 間状媒体の製造方法である。

以下、この発明について詳しく説明する。この発明においてスペッタとは低圧気体中でプラスマを発生させ、そのときに生ずる高エネルヤーセチの債等により固体表面から固体を構成する原子あるいは分子を放出させ、これら原子あるいは分子を物品の表面に付着させて膜を形成させる方法である。

基体はアルミニウム、 ガラス、 合成 樹脂 たどの 非 磁性硬質 材料を円筒形に成形したものである。 基体表面は うねり、 表面祖さを 充分に小さくして かく 必要がある。

磁性材料は Co-Pt、 Co-Cr などの合金であり、 これらの金貨を扱状に 放形したものをメーゲット とする。 2 枚のメーゲットの向い合わせる間解は 基体の円筒の長さ程度か、 それ以上が好ましい。

以下、実施例かよび比較例により本発明を具体的に説明する。基体として外径30歳、内径27歳、長さ60歳のアルミュウム円筒を単偏した。円筒の表面をラッピングした後に無電解メッキ法でニッケル・リンからなる厚さ30ヵmの硬質の下地層を設け、下地層を鏡面ポリッシイングした。

1 2 個の円筒 9 をターゲットの周囲に、両ターゲットの中心軸と平行に配置した。各円筒の軸に

特開昭63-303063(3)

は歯車10を設け、チェーン(図示をし)により 各円筒を自転可能にした。ホルダー3人、3Bを 電源11のマイナス端子に接続し、円筒、ペルジ ヤーシよびグラウンド・シールド板は接地し、電 顔のプラス端子も接地した。

ガス排気口 8 に真空ポンプ(図示なし)を接続してペルジャー内の空気を排気して圧力 1×10^{-6} torr の真空にし、ついでガス導入口よりアルゴンガスを導入して、ペルジャー内の圧力を 5×10^{-3} torr にした。

ホルダーにマイナス700Vの直流電圧を印加し、電流1.35 A、電力密度6 W/cm² で約6分間スパッタを行ない、基体の表面にコパルト・自金からなる厚さ2000 A の磁性層を形成した。ついで、ターゲットを爆鉛(形、大きさは Co-Pt のときと同じ)に取替え、アルゴンガス圧力5×10-3 torr、ホルダー印加電圧マイナス600 V、電流1.30 A、電力密度5 W/cm²、スパッタ時間9分間の条件で、磁性層の表面に厚さ500 A の炭素質保護線を形成させた。

つた。

(比較例)

類 5 図に示すとおり、 プレーナ・マグネトロン 表記 (傍田契作所 CPS ~ 8 E S 形) に度 色 1 2 7 mm、 厚さ 3 mm の 1 枚の Co ~ Pt (原子比 8 2 : 1 8) からなるターゲット 1 を設け、 その展 何にプラズマ を閉じこめるための 磁石 2 を固定した。ホルゲー 3、 絶像体 4、 ペルジャー 5、 グラウンド・シールド 板 6、 ガス 導入 口 7 かよび ガス排気 口 8 については実施例と同様に設けた。

契約例と同じ円筒 9 を 3 本、 ターゲットの上部 に ターゲットに 平行に 設 献 した。 各円 筒の 軸には 繊 車 1 0 を 設け、 チェーン (図示 なし) に よ 9 自 転 可 能 に し た。 電 張 の 接 続 か よ び 真 空 ポンプ の 接 機 に ついて は 実 施 例 と 同 じ に し た。

ベルジャー内をアルゴンガス圧力 5 × 1 0⁻⁵ torr とし、ホルダー印加電圧マイナス 4 0 0 V (直流) 促流 1.9 A、電力密度 6 平 / cm² で約 1 2 分間ス パッタを行ない、円間の表面にコパルト・白金か 5 なる厚さ 2 0 0 0 Å の磁性層を形成した。つい 得られた12本の磁気配録円筒状媒体のうちの 1 本の円筒の袋面に等間隔で8本のトラックを設 定した。これら各トラックに磁気ヘッドを接近さ せて配数周波数(1 MHz および7 MHz)による記 録・再生を行なつて再生出力のパラッキを調べた。 ついて、磁気配録円筒状媒体をトラック別に動切 りにして、さらにこれを切りきざんで7mm× 7mm の切片とし、それぞれの磁気特性を測定した。例 定装置は短研電子社製の扱動試料形磁力計(形式 BHV - 5 5)により、外部磁乳15m がウスで例 定した。

これらの紛奏は終りに示すとおり、磁気特性、 再生出力ともにトラック間のパラッキが小さく、 満足すべきものであつた。

いつぼう、スパッタを終えた12本の磁気配録 円筒状媒体のそれぞれほぼ中央に1本のトラック を設定し、前配と何じ条件で再生出力のペラッキ かよび磁気特性を測定した。これらの結果は衰2 に示すとわり、磁気特性、再生出力ともに円筒状 媒体間のパラッキが小さく、濃足すべきものであ

で、ターゲットを無鉛に取着え、アルゴンガス圧 力 5 × 1 0⁻² torr、ホルダー印加電圧マイナス 5 5 0 V (直流)、電流 1-1 5 A、電力密度 5 W /cm² で約 1 5 分間 スパッタを行ない、磁性層の 表面に厚さ 5 0 0 Å の炭素質保護膜を形成させた。

得られた3本の磁気記録円間状媒体のうちの1 本については実施例と同じく8本のトラックを設定して、磁気特性かよび再生特性を測定した。また、3本の磁気記録円筒のそれぞれほぼ中央に1 本のトラックを設定し、それぞれの磁気特性かよび再生特性を測定した。これらの結果は表3かよび表4に示すとかり、磁気特性、再生出力ともに実施例よりパラッキが大きかつた。

		K	-		
	概	存在		再生出力	T.
1922	抗量力Bc	政部田東Mr	我智祖東以广 他和田東山8	1 MHz	7MBr
梅	(エルステッド) (10~4 8回)	(10-4 cm)	(10-4emu)	(Vp-p)	(a_{p-p})
-	1600	59	11	1.08	0.25
2	1620	58	02	1.10	0.25
ю.	1610	59	1/2	1.16	0.24
4	1600	09	72	1.0	0.24
5	1590	61	73	1.12	0.26
9	1600	09	11	1.04	0.26
7	1610	63	69	1.10	0.27
æ	1620	62	7.0	1.10	0.26
中	1606	60.3	70.9	1.09	0.26
は個	=	1.7	1.3	0.05	0.01

~

K

8.7	7MBx	(q-qV)	0.24	0.25	0.25	0.24	0.26	0.25	0.24	0.26	0.25	0.26	0.24	0.26	0.25	0.01
再生出力	1 MBs	(Vp-p)	1.16	1.08	1.10	1.05	1.10		1.05	1.10	1.05	1.10	1.07	1.10	1.08	0.03
	のお田東山の	(10-4emu)	71	70	72	72	70	7	71	70	11	7.0	11	2	70.8	0.8
数条件	発育曲集Mr	(10-4-mu)	59	58	59	90	59	09	09	59	09	59	90	19	59.5	0.8
田	抗磁力 Hc	(ILATOF)	1590	1600	1620	1610	1600	1580	1590	1600	1605	1610	1600	1620	1602	12
EC.	中中		-	2	3	4	2	•	^	8	٥	2	=	12	平均	森

1900	梅	数级条件		再生出力	出力
中中	抗磁力 Hc (エルステッド)	残留盘束¼r (10-⁴emu)	残留政策Vr 的和政策Vs (10-*emu) (10-*emu)	(Vp-p)	7ME (vp-p)
-	1 800	25	35	0.5	0.15
2	1730	30	40	0.75	0.18
33	1600	40	53.3	0.86	0.18
4	1550	. 55	73	1.02	0.20
5	1620	58	83	1.25	0.16
9	1680	53	7.6	1.03	0.15
7	1700	35	50	0.70	0.17
8	1750	28	42	0.80	0.19
4	1679	41	57	0.86	0.17
· · · ·	84	13	18	0.23	0.02

联

1.5 ~0.76 0.16-0.13 0.13 再生出力 $(\mathbf{d} - \mathbf{d} \mathbf{\Lambda})$ 1 MB 2 1.50 0.80 1.0 的和研究Me (10-4eau) 42 42 ı 107 45 65 107 及留田東Mr (10-4emu) 靯 33 30 70 , 33 44 Ŕ SK. 坑田力 Hc (エルステッド) 1700-1400 揮 1700 1400 1680 1593 超中 中 # ~ M 田 梅 爆

-334-

嵌

特開昭63-303063 (5)

(発明の効果)

本発明によればスパッタ法により磁気特性かよび将生出力のパラッキが少ない均質な磁気記録円筒状媒体を能率よく、磁性体の無駄なく製造することが可能となる。

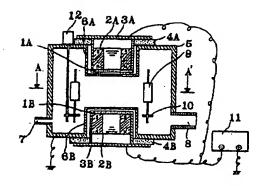
4.図面の簡単左説明

第1回は本発明の磁気記録円筒状媒体の製造方法を示す凝断面図である。第2図は第1図のA-A'面で換断した機断面図である。第3図は比較例の磁気記録円筒状媒体の製造方法を示す凝断面図である。

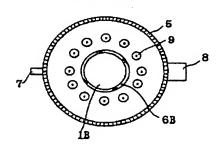
符号1、1 A、1 B … ターゲット、2、2 A、2 B … 磁石、3、3 A、3 B … ホルダー、4、4 A、4 B … 絶像体、5 … ペルジャー、6、6 A、6 B … グラウンド・シールド板、7 … ガス導入口、8 … ガス游気口、9 … 円筒、1 0 … 歯車、1 1 … 電源、1 2 … 円筒回転収動装置

符許出頭人 電気化学工業株式会社





第2図



第 3 図

